

속보 자료

투자자 관련 담당:

Ed Lockwood
전무 이사, 투자자 관계
1-(408) 875-9529
ed.lockwood@kla-tencor.com

언론 관련 담당:

Meggan Powers
전무 이사, 기업 커뮤니케이션
1-(408) 875-8733
meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor, 새로운 결함 검출 및 모니터링 기술 발표

NanoPoint™, 중요 패턴을 활용하여

신속하고 실용적인 설계 검증과 고도로 민감한 공정 모니터링 지원

캘리포니아주 밀피타스, 2013. 4. 23.— [KLA-Tencor Corporation](#)(NASDAQ: KLAC)은 오늘 자사의 D5 웨이퍼 결함 검사 시스템에 사용되는 새로운 특허 기술 제품군인 NanoPoint™를 공개했다. NanoPoint는 기존 광학 결함 검사 장비에서 광학 속도로 결함을 검출 및 모니터링하는 완전히 새로운 방식을 나타낸다. NanoPoint는 이전에 첨단 노드 제품에서 수율에 영향을 끼치는 미세한 불량을 검출하는데 기존에 제한을 주었던 고집적화된 패턴들에 있는 LER(line-edge roughness)이 있는 전단 Metal 레이어들(layer)에서 이미 가치가 입증되었다.

KLA-Tencor 웨이퍼 검사(WIN) 사업부 부사장 겸 사업 본부장인 Keith Wells는 "우리 고객은 20nm 노드 이상급까지 광학 인라인 결함 검사 기술의 활용 범위를 확대하려는 데 관심이 높다. 광학 검사를 통해서만 가능한 속도와 기존 검출 능력을 보존하기를 원하는 것이다. 우리에게서 갈수록 검사 파장보다 크기가 작아지는 결함을 발견해낼 수 있는 장비를 설계하는 것이 관건이다. 과거에는 광원과 기타 하위 시스템을 개선해왔지만 NanoPoint는 아예 새로운 차원에서 문제를 해결해 준다. 고객 피드백으로 볼 때 NanoPoint는 레이어 및 공정 모듈에 걸쳐 폭넓게 적용할 수 있는 잠재력을 지닌 혁신적인 기술이라고 믿는다"고 밝혔다.

NanoPoint는 회로 설계자가 지정하거나 알려진 불량 지점을 기준으로 중요 패턴에 광학 검사 시스템의 역량을 집중한다. 칩 개발 과정에서 NanoPoint는 마스크 재설계가 필요한지 여부를 몇 시간 안에 알려 주어 설계상의 문제를 파악하고 해결하는 시간을 몇 개월에서 며칠로 단축할 수 있다. 대량 생산 과정에서는 중요 패턴 내에서 결함을 선별적으로 추적하여 지금까지 업계에서 경험하지 못한 높은 수준의 감도와 속도의 공정 모니터링을 가능하게 한다.

몇 가지 새로운 패턴을 기반으로 한 NanoPoint 기술은 WIN 사업부와 기술 전문가 Ben Tsai 박사가 이끄는 KT 연구소를 통한 KLA-Tencor의 오랜 연구 개발 노력의 산물이다. 이미 여러 대의 NanoPoint 시스템이 북미와 유럽, 아시아의 논리 소자, 반도체 및 메모리 칩 제조업체에 설치되었다. NanoPoint 기술에 대한 자세한 내용은 KLA-Tencor의 [2900 시리즈 제품 웹 페이지](#)에서 확인할 수 있다.

KLA-Tencor 소개:

KLA-Tencor Corporation 은 공정 관리 및 수율 관리 솔루션 공급업체의 선두 기업으로서, 전 세계 고객들과 협력하여 최첨단 검사 및 측정 기술을 개발하고 있다. 이러한 기술은 반도체, LED 및 기타 관련 나노 전자부품 산업에 사용된다. 업계 표준 제품의 포트폴리오와 세계적인 수준의 엔지니어/연구 팀을 보유하고 있는 KLA-Tencor 는 35 년 이상 고객을 위한 우수한 솔루션을 만들고 있다. 미국 캘리포니아주 밀피타스에 본사가 있는 KLA-Tencor 는 전 세계적으로 고객 영업 및 서비스 전담 센터를 운영하고 있다. 보다 자세한 정보는 <http://www.kla-tencor.com>(KLAC-P)에서 참조할 수 있다.

전망 기술:

이 언론 보도 자료에서 발표된 NanoPoint 기술 또는 D5 시리즈 결합 검사 시스템의 예상 성능, 반도체 산업의 추세 및 그와 관련하여 예상되는 과제, KLA-Tencor 고객의 NanoPoint 기술 또는 D5 시리즈 도구의 예상되는 사용 방식, NanoPoint 기술 또는 D5 시리즈 도구 사용자에게 예상되는 비용 및 운영상/기타 이점 등의 내용은 미래를 전망하는 내용으로, 1995 년의 Private Securities Litigation Reform Act(증권민사소송개혁법)에 따라 제정된 Safe Harbor(면책 규정) 조항의 적용을 받는다. 이러한 전망에 대한 내용은 현재 정보와 예측을 근거로 이루어졌으며 많은 위험성과 불확실성이 수반된다. 신기술 채택의 지연(비용 또는 성능 문제 또는 다른 이유로 인해), 다른 회사에서 제공하는 경쟁제품의 도입, KLA-Tencor 제품의 구현, 성능 또는 사용에 영향을 주는 예상치 못한 기술적 어려움이나 한계 등 다양한 요인으로 인해 실제 결과는 해당 내용에서 예측된 것과 크게 다를 수 있다.

###